

Установка измерения геометрических параметров пластин FLA-200

Установка измерения геометрических параметров пластин FLA-200

Производитель:

Napson

Цена:

Цена по запросу

Описание

Измерения в данной системе производятся бесконтактным методом, что исключает разрушение рабочей поверхности пластины. Установка позволяет проводить измерение таких параметров пластин, как толщина, разнотолщинность (TTV), прогиб (BOW), коробление (WARP), локальная и глобальная плоскостность пластин в соответствии со стандартами ASTM. Система позволяет работать с пластинами диаметром до 300 мм. Измерение толщины производится в диапазоне 500 мкм без проведения повторной калибровки. Система позволяет проводить измерение 12,000 точек по поверхности в течение 1 минуты. Результаты картографирования поверхности могут быть представлены в виде 2D/3D изображений, возможен импорт данных в Excel.

Область применения:

- Измерение геометрических характеристик полупроводниковых пластин Si, poly-Si, SiC, GaAs, GaN, Ge, InP, сапфира, кварца
- Контроль поверхности пластин после технологических операций дисковой/проволочной резки слитков, шлифовки, полировки, утонения, травления

Технические характеристики:

Диаметр пластин	76, 100, 150, 200 мм 300 мм (опция)
Диапазон измерения толщины	200 - 1200 мкм, точность $\pm 0,5$ мкм
Диапазон измерения прогиба (BOW)	± 350 мкм, точность ± 3 мкм
Диапазон измерения коробления (WARP)	до 350 мкм, точность ± 3 мкм

Плоскостность [локальная]	точность $\pm 0,15$ мкм, воспроизводимость 0,05 мкм
Плоскостность [глобальная]	точность $\pm 0,15$ мкм, воспроизводимость 0,05 мкм
Управление	РС и специализированное ПО